# Мощные поперечно-одномодовые полупроводниковые лазеры с гребнёвой конструкцией оптического волновода

В.В.Поповичев<sup>\*</sup>, Е.И.Давыдова<sup>\*</sup>, А.А.Мармалюк<sup>\*</sup>, А.В.Симаков<sup>\*</sup>, М.Б.Успенский<sup>\*</sup>, А.А.Чельный<sup>\*</sup>, А.П.Богатов<sup>\*\*</sup>, А.Е.Дракин<sup>\*\*</sup>, С.А.Плисюк<sup>\*\*\*</sup>, А.А.Стратонников<sup>\*\*\*</sup>

Оптимизация волноводных свойств гребнёвой структуры полупроводникового гетеролазера позволила получить поперечно-одномодовую генерацию с выходной мощностью в непрерывном режиме свыше 200 мВт. Качество оптического пучка близко к дифракционному пределу, а его яркость превышает  $5 \times 10^7 \, \text{Bm} \cdot \text{cm}^{-2} \cdot \text{cp}^{-1}$ . Показано, что расчетные и экспериментальные параметры оптического пучка лазера совпадают с высокой точностью, что допускает их уверенное моделирование.

Ключевые слова: гребнёвый лазер, эффективный показатель преломления, дифракционный пучок.

#### 1. Введение

Одной из замечательных идей, сформулированных Н.Г.Басовым и его соавторами, была идея использования полупроводника в качестве активной среды лазера [1]. Насколько она была пророческой, свидетельствует тот факт, что в 2000 г. 75 % объема продаж всех типов лазеров [2] пришлось на полупроводниковые лазеры. Это является практическим подтверждением уникальных свойств полупроводниковых лазеров. Например, для ряда полупроводниковых лазеров, работающих в стандартных условиях, полный КПД лазера может превышать 50 %, что всего лишь вдвое меньше, чем у идеального источника.

Высокая наукоемкость полупроводникового лазера уже на протяжении более 40 лет обеспечивает непрерывное совершенствование его параметров за счет развития как физики полупроводников, так и квантовой электроники.

В настоящей статье изложены некоторые результаты исследований в области создания поперечно-одномодовых гребнёвых лазеров, работающих в красной и ближней ИК ( $\lambda \leq 1.5$  мкм) областях спектра. Лазеры этого типа позволяют наглядно продемонстрировать, каким образом решение современной физической задачи приводит к достижению высокого практического результата – созданию лазера с расходимостью пучка, близкой к дифракционному пределу, и с плотностью потока излучения, близкой к определяемой оптическим разрушением материала.

Поступила в редакцию 4 октября 2002 г.

# 2. Оптическое ограничение пучка в активной среде в горизонтальном направлении

Хорошо известно, что в подавляющем большинстве случаев поперечное распределение поля электромагнитной волны полупроводниковых лазеров определяется оптическим волноводом, т. е. задается поперечным распределением диэлектрической проницаемости активной области. В направлении, перпендикулярном слоям структуры (его обычно называют вертикальным), оптический волновод всегда задан структурой слоев, в которой каждый слой имеет свой показатель преломления, а все вместе они образуют квазиплоский волновод. В другом поперечном направлении (горизонтальном) ситуация может быть более сложной. В исследуемых в настоящей работе лазерах оптическое ограничение пучка, или оптический волновод, в горизонтальном направлении обеспечивается гребнёвой конструкцией структуры.

На рис.1 представлены схема и изображение выходной грани лазера, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа. Такая структура изготавливается следующим образом. Верхние слои планарной гетероструктуры подвергаются профилированному травлению только в у-направлении, в то время как в z-направлении структура не травится, поэтому окончательная форма имеет вид гребня шириной W. В области гребня |y| < W/2 травление не идет и структура сохраняет свой первоначальный вид. Вне гребня (|y| > W/2) вытравливаются все слои, находящиеся выше р-эмиттера, и частично травится *р*-эмиттерный слой. В результате толщина гребня h изменяется вдоль оси y от значения dem – начальной толщины эмиттерного слоя при |y| < W/2, до некоторого значения  $h_{\rm s}$  при достаточно больших у ( $|y| \gg W/2$ ). Затем вся верхняя часть структуры, за исключением поверхности гребня, покрывается или заращивается изолирующим слоем. Окончательно на всю поверхность наносится металлический контактный слой. Таким образом, верхний электрический контакт структуры подводится только к поверхности гребня.

При прохождении тока через электрический канал,

<sup>\*</sup>ФГУП «НИИ "Полюс" им. М.Ф.Стельмаха», Россия, 117342 Москва, ул. Введенского, 3

<sup>\*\*</sup>Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН, Россия, 119991 Москва, Ленинский просп., 53

<sup>\*\*\*</sup>Московский физико-технический институт (государственный университет), Россия, 141700 Долгопрудный, Московская обл., Институтский пер., 9



Рис.1. Схема (а) и фотография выходного зеркала (б) гребнёвого лазера.

ограниченный шириной гребня W, в направлении оси у создается некоторая оптическая неоднородность комплексной диэлектрической проницаемости (за счет изменения усиления) и показателя преломления активного слоя (за счет изменения концентрации носителей). Эта неоднородность может придавать структуре волноводные свойства - создавать волновод, наведенный усилением (gainguide). Однако многочисленные исследования показали, что волноводные свойства такого волновода совершенно недостаточны для формирования устойчивого распределения поля в направлении у даже при мощностях излучения в несколько милливатт. Поэтому основной волноводный эффект в горизонтальном направлении для настоящих лазеров создается самой формой гребня за счет соответствующего изменения остаточной толщины h верхнего эмиттерного слоя вдоль направления у.

Пронализируем волноводные свойства структуры в рамках приближения эффективного показателя преломления, развитого и исследованного ранее в большом числе работ (см., напр., [3, 4] и ссылки в них).

Как видно из рис.1, в результате формирования гребня диэлектрическая проницаемость  $\varepsilon$  становится функцией поперечных координат x и y даже в отсутствие накачки, т. е. для «холодной» активной области. В основе приближения лежит то обстоятельство, что в большинстве практически интересных случаев пространственное распределение амплитуды поля E в лазере можно представить в следующем виде:

$$E = U(x, y)V(y)\exp(i\beta z - i\omega t), \qquad (1)$$

где  $\beta$  – комплексная константа распространения излучения вдоль оси z';  $\omega$  – частота излучения. Изменение амплитуды поля E вдоль оси x происходит значительно быстрее, чем вдоль оси y, т. е.

$$\left|\frac{\partial U}{\partial x}\right| \gg \left|\frac{\partial U}{\partial y}\right|, \quad \left|\frac{1}{U}\frac{\partial U}{\partial x}\right| \gg \left|\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial y}\right|. \tag{2}$$

Подставив выражения для поля (1) в скалярное волновое уравнение и выполнив элементарные операции, получим

$$\frac{1}{U}\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{1}{U}\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + 2\frac{1}{UV}\frac{\partial U}{\partial y}\frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(x,y) + \frac{1}{V}\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} - \beta^2 = 0.$$
(3)

Поскольку два последних члена не зависят от x, а являются только функцией y, то эту функцию можно обозначить через  $\tilde{\beta}^2(y)$ :

$$\tilde{\beta}^2(y) = \beta^2 - \frac{1}{V} \frac{\partial^2 V}{\partial y^2}.$$
(4)

Тогда уравнение (3) перепишется в виде

$$\frac{1}{U}\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \frac{1}{U}\frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + 2\frac{1}{UV}\frac{\partial U}{\partial y}\frac{\partial V}{\partial y} + \frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(x,y) - \tilde{\beta}^2(y) = 0.$$
(5)

Если использовать соотношения (2), то уравнение (5) примет следующий вид:

$$\frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + \left[\frac{\omega^2}{c^2}\varepsilon(x,y) - \tilde{\beta}^2\right]U = 0.$$
(6)

Решение (6) соответствует решению задачи для плоского диэлектрического волновода, у которого диэлектрическая проницаемость является функцией одной переменной x, а значение y является только параметром задачи. Поэтому, взяв некоторое фиксированное  $y_0$  и решив (6), мы находим одновременно  $U(x, y_0)$  и  $\tilde{\beta}^2(y_0)$ . Перебирая все значения  $y_0$ , мы, таким образом, определяем функцию  $\tilde{\beta}^2(y)$ . Нетрудно видеть, что физический смысл  $\tilde{\beta}^2(y)$  соответствует константе распространения волны в плоском диэлектрическом волноводе. Соответственно эту функцию можно представить как

$$\tilde{\beta}^2(y) = \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{\epsilon}_{\text{eff}}(y) = \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{n}_{\text{eff}}^2(y), \tag{7}$$

где  $\tilde{\epsilon}_{\rm eff}(y)$  – эффективная диэлектрическая проницаемость;  $\tilde{n}_{\rm eff}$  – эффективный показатель преломления. Подставляя затем найденное  $\tilde{\beta}^2(y)$  в (4), получаем уравнение, аналогичное (6):

$$\frac{\partial^2 V}{\partial y^2} + \left[\frac{\omega^2}{c^2}\tilde{\varepsilon}_{\rm eff}(y) - \beta^2\right]V = 0.$$
(8)

Решив его, окончательно находим выражение для поля (1), включая комплексную константу распространения  $\beta$ .

Таким образом, двумерная волноводная задача решается последовательно, как две одномерных задачи при решении уравнений (6) и (8). Вначале для диэлектрической проницаемости фиксируется значение  $y = y_0$  и решается задача для волновода, диэлектрическая проницаемость которого  $\varepsilon$  является функцией только  $x: \varepsilon(x) \equiv \varepsilon(x, y_0)$ . Результатом решения является  $\tilde{\beta}^2(y_0)$  или  $\tilde{\epsilon}_{eff}(y_0)$ и  $\tilde{n}_{eff}(y_0)$ . Далее найденные для различных  $y_0$  значения  $\tilde{\epsilon}_{eff}(y_0)$  или  $\tilde{n}_{eff}(y_0)$  рассматриваются как функции уже y, и еще раз решается одномерная задача (7), но уже с некими



Рис.2. Зависимость эффективного показателя преломления от остаточной толщины p-эмиттерного слоя  $h_{\rm s}$ .

эффективными значениями  $\tilde{\varepsilon}_{\rm eff}(y)$  или  $\tilde{n}_{\rm eff}(y_0)$ . В связи с этим данный метод называется методом эффективного показателя преломления.

Поскольку метод разделения переменных при решении волнового уравнения и условие (2) уже использовались ранее, то, конечно, существуют хорошо известные аналоги этого метода, например приближение Борна-Оппенгеймера. Роль «быстрой» координаты х играет электронная координата, а роль «медленной» координаты у – координата ядер. Основным достоинством этого метода является его простота при сравнительно удовлетворительной точности. Попутно заметим, что условия (2) являются неявными, поскольку изначально ни одна из функций U(x, y) и V(y) не известна. Тем не менее вначале можно решить задачу, предполагая, что условия (2) верны, а затем вернуться к ним и проверить, насколько адекватно полученное решение. Кроме того, в принципе можно уточнить решение, учтя доминирующую поляризацию излучения при решении уравнений (6) и (8). Точность получаемых таким образом решений с учетом поляризации остается вне рамок настоящего обсуждения.

Итак, кусочнопостоянная функция  $\varepsilon(x, y_0)$  задается ее значениями для всех слоев структуры (см. рис.1) и толщиной этих слоев. Причем определенному значению  $y_0$  соответствует определенная толщина  $h(y_0)$  *p*-эмиттерного слоя. Решив уравнение (6) для набора толщин *h*, мы найдем  $\tilde{n}_{\rm eff}(h)$ . Пример такой зависимости для использованной в настоящей работе квантоворазмерной гетероструктуры показан на рис.2. Затем, используя данные об экспериментально измеренном профиле травления эмиттерного слоя h(y), окончательно находим зависимость поперечного распределения эффективного показателя  $\tilde{n}_{\rm eff}(y)$ :

$$\tilde{n}_{\rm eff}(y) \equiv \tilde{n}_{\rm eff}[h(y)]. \tag{9}$$

На рис.3 представлены рассчитанные с учетом данных рис.1 и 2 горизонтальные профили эффективного показателя преломления для двух гребнёвых структур, различающихся значениями  $h_s$ . Профили позволяют рассчитать волноводный эффект для горизонтального направления в полупроводниковом лазере гребнёвой конструкции. На рис.3 представлена только реальная часть  $\tilde{n}_{\text{eff}}(y)$ , тем не менее очевидно, что вследствие комплексности значений  $\varepsilon(x, y)$  расчеты дают комплексные значения  $\tilde{\beta}^2(y)$  и  $\tilde{n}_{\text{eff}}(y)$ . В связи с этим эффективный горизонтальный профиль комплексной диэлектрической проницаемости  $\tilde{z}_{\text{eff}}(y)$  включает в себя профиль как показателя преломления, так и усиления (поглощения).



Рис.3. Расчетный профиль эффективного показателя преломления в горизонтальной плоскости.

## 3. Оптимизация волновода для получения лазерного пучка высокой яркости

Исследования показали, что для получения высокой мощности в одной поперечной моде необходима оптимизация волновода, создаваемого гребнёвой структурой. Эта оптимизация является результатом баланса противоположных факторов, воздействующих на лазерную генерацию при изменении волноводного эффекта. Так, если волновод в горизонтальном направлении слабый, т.е. скачок эффективного показателя преломления  $\Delta \tilde{n}_{\rm eff} \leqslant 10^{-3}$ , то хотя режим одномодовой генерации сохраняется до высоких мощностей, само распределение поля формируется за счет не только конструктивновстроенного статического волновода, но и динамического волновода, возникающего из-за температурного перепада между центром активной области и удаленными пассивными (не накачиваемыми) областями. Возможно также формирование пространственного профиля показателя преломления вследствие механических напряжений при пайке лазерного диода. И наконец, один из самых нежелательных эффектов такого рода – это антиволноводное действие инжектируемых носителей.

Все перечисленные факторы примерно одинаково воздействуют на волноводный эффект и вызывают  $\Delta \tilde{n}_{\rm eff} \sim 10^{-3}$ . Это приводит к тому, что горизонтальное распределение амплитуды поля становится нестабильным, изменяясь с током инжекции лазера, в результате чего может возникнуть нелинейность ватт-амперной характеристики, называемая кинком. Для устранения этого нежелательного явления необходимо увеличивать эффективность конструктивно-встроенного волновода путем увеличения скачка эффективного показателя преломления  $\Delta \tilde{n}_{\rm eff}$ .

Казалось бы, этого можно достичь более глубоким травлением *p*-эммитерного слоя, чтобы уменьшить его толщину  $h_s$  вне области гребня. Однако при значительном увеличении  $\Delta \tilde{n}_{eff}$ , например до  $10^{-2}$ , волновод уже может поддерживать не только одну фундаментальную моду, но и несколько высших мод. При увеличении  $\Delta \tilde{n}_{eff}$ пороги генерации всех этих мод сближаются. На рис.4 представлены зависимости порогового тока для первых трех мод от толщины  $h_s$ , рассчитанные с учетом данных, аналогичных представленным на рис.3. Видно что при  $h_s \leq 0.37$  мкм возможна генерация как на фундаменталь-



Рис.4. Зависимости пороговых токов первых трех мод от остаточной толщины p-эмиттерного слоя  $h_{\rm s}$ .

ной, так и на первой моде, а при  $h_{\rm s} \leq 0.1$  мкм – и на второй моде. Следовательно, при токах накачки, соответствующих выходной мощности ~10 мВт, возникает режим генерации на нескольких поперечных модах. Заметим, что распределение отдельной выделенной поперечной моды в таком лазере очень стабильно.

Таким образом, конструкции гребнёвого лазера оптимизируется для того, чтобы, с одной стороны, создать горизонтальный волновод с достаточно большим  $\Delta \tilde{n}_{\rm eff}$ , обеспечивающим стабильное распределение поля фундаментальной моды; с другой стороны,  $\Delta \tilde{n}_{\rm eff}$  должно быть достаточно малым, чтобы предотвратить возбуждение многомодовой генерации. Этот выбор является одной из главных задач при получении высокой мощности в режиме генерации одной поперечной моды. Мысль о необходимости такого рода оптимизации горизонтального волновода была высказана Роем Ленгом [5] еще в 1979 г. Однако, для того чтобы создать лазер с оптимальным волноводом, потребовались усилия большого числа исследователей, имеющих дело с различными вариантами технических решений. Каждый этап исследований в этом направлении характеризовался своими достижениями. Здесь уместно отметить работу [6], в которой получены одни из наилучших в настоящее время результатов. В этом плане настоящая работа тоже отражает определенный уровень, достигнутый в направлении создания полупроводниковых лазеров с дифракционно-ограниченной расходимостью пучка. Ниже приведены экспериментальные результаты, которые характеризуют этот уровень.

### 4. Эксперимент

В настоящей работе исследованы образцы гребнёвых лазеров, изготовленные на основе квантоворазмерных полупроводниковых гетероструктур в системе  $In_xGa_{1-x}As/Al_yGa_{1-y}As/GaAs$ . Данные по слоям структуры и их показателям преломления, а также их скорректированные значения (даны в скобках) приведены в табл.1. Резонатор лазерных диодов имел длину 1000 мкм, а коэффициенты отражения выходного и заднего зеркал составляли 3 % и 95 % соответственно. Все измерения были выполнены в непрерывном режиме работы лазеров без принудительного охлаждения при комнатной температуре.

Распределение интенсивностей в дальней зоне лазера регистрировалось автоматизированной с помощью компьютера установкой, описанной ранее в [7]. Распределе-

Табл.1. Характеристики слоев исследуемой лазерной структуры.

Номер слоя	Слой	Состав слоя х	Толщина (мкм)	Показатель преломления
1	p <sup>+</sup> -GaAs	_	0.4	3.529
2	p-Al <sub>x</sub> Ga <sub>1-x</sub> As	0.34 (0.349)	1.66	3.339 (3.334)
3	$Al_xGa_{1-x}As$	0.3 (0.295)	0.12	3.362 (3.365)
4	GaAs	_	0.007	3.529
5	$In_xGa_{1-x}As$	0.2	0.0053	3.60
6	GaAs	_	0.007	3.529
7	$In_xGa_{1-x}As$	0.2	0.0053	3.60
8	GaAs	_	0.007	3.529
9	$Al_xGa_{1-x}As$	0.3 (0.295)	0.12	3.362 (3.365)
10	$n-Al_xGa_{1-x}As$	0.34 (0.349)	3.0	3.339 (3.334)
11	<i>n</i> -GaAs	-	100	3.529

ние интенсивности оптического потока на выходном зеркале лазера (ближняя зона) регистрировалось с помощью специальной оптической установки, включающей в себя высококачественный микрообъектив  $0/\infty$  с числовой апертурой 0.65 и фокусным расстоянием 6.3 мм. Микрообъектив проецировал выходное зеркало лазерного диода на ПЗС-матрицу фотоприемников ( $256 \times 256$  пикселей), сигнал с которой анализировался ПК. Требуемое ослабление оптического потока достигалось за счет использования промежуточных зеркал, расположенных между объективом и ПЗС-матрицей. Такими зеркалами служили оптические стеклянные поверхности без покрытия с коэффициентами отражения 4 % – 5 %.

Установка обеспечивала 260-кратное увеличение изображения, так что 1 мкм в плоскости выходного зеркала лазера приходился на 20 пикселей ПЗС-матрицы. Для анализа сигнала ПЗС-матрицы было разработано оригинальное программное обеспечение, позволяющее провести факторизацию двумерного распределения интенсивности в плоскости ПЗС-матрицы в виде произведения одномерных распределений вдоль координат *x* и *y*:

$$P(x, y) = S(x)F(y),$$
(10)

где  $S(x) \simeq |U(x,0)|^2$ ;  $F(y) = |V(y)|^2$ , что наиболее адекватно представлению поля согласно соотношениям (1) и (2).

На рис.5 показано распределение интенсивности лазерного пучка в ближней и дальней зонах для «быстрого» (вдоль оси x) направления, перпендикулярного слоям структуры (см. рис.1). Многочисленные измерения, выполненные как в настоящей работе, так и ранее, свидетельствуют, что эти распределения с высокой точностью одинаковы для всех образцов лазеров, если образцы изготовлены из одной партии. Более того, эти распределения в подавляющем большинстве случаев не зависят от режима работы лазера и характеризуют структуру в целом.

Анализируя кривые рис.5, *а*, можно заметить, что распределение, рассчитанное по данным для состава слоев, заложенным в процессе изготовления структуры, несколько у́же (штриховая кривая) экспериментального распределения. Скорректировав составы в пределах погрешности изготовления структур ( $\pm 2\%$ ), можно достичь практически полного совпадения экспериментального и расчетного распределений интенсивности в дальней зоне. Отметим, что экспериментальные точки рис.5, *а* обозначены квадратами с существенно увеличенными размерами по сравнению с погрешностью измерений.



Рис.5. Распределение интенсивности  $\Phi(\phi)$  в дальней зоне (*a*) и распределение S(x) в ближней зоне (*б*) в вертикальной плоскости.

Расчет выполнялся методом, описанным в [8,9], для центра гребня (y = 0); в результате расчета были получены распределения интенсивности в дальней зоне  $\Phi(\phi)$  и в ближней зоне  $S(x) \sim |U(x,0)|^2$ . Таким образом, результаты измерений полученного распределения интенсивности в дальней зоне могут быть использованы для контроля параметров выращенной гетероструктуры.

Распределение интенсивности в ближней зоне (рис.  $5,\delta$ ) S(x) имеет почти тривиальный вид. Расчетная кривая, соответствующая квадрату модуля амплитуды поля собственной моды  $|U(x)|^2$ , находится внутри экспериментального распределения из-за конечного пространственного разрешения установки, ограниченного исключительно аберрацией объектива. Это следует из хорошего совпадения экспериментальных данных с расчетной кривой аппаратной функции объектива для одномерного случая и когерентного освещения, имеющей в данном случае вид

$$S(x) = \left[\frac{\sin(kAx)}{kAx}\right]^2,\tag{11}$$

где  $k = 2\pi/\lambda$  – волновой вектор в вакууме; A – числовая апертура объектива. Заметим, что условие одномерности связано со значительной эллиптичностью пучка лазера и соответствует соотношениям (2).

Распределения интенсивности излучения в горизонтальной плоскости уже не столь однозначны, как в вертикальной, что можно видеть из рис.6. Расчет выполнен для профиля  $\tilde{\epsilon}_{eff}(y)$ , найденного методом, описанным в разд.2, с учетом реальной геометрии гребнёвой структуры (использована зависимость h(y) из рис.1). Остаточная толщина *р*-эммиттерного слоя  $h_s = 0.45$  мкм при ширине гребня W = 3.6 мкм. Эффективность «встроенного» волновода, образованного такой структурой, характеризуется скачком  $\Delta \tilde{n}_{eff} \approx 3 \times 10^{-3}$ . При незначительных токах накачки (35–40 мА), соответствующих



Рис.6. Распределение интенсивности в дальней (*a*) и ближней (*б*) зонах в горизонтальной плоскости при разных токах накачки.

малому превышению порога лазерной генерации, экспериментальные и расчетные распределения практически совпадают, хотя экспериментальная кривая F(y) несколько уже расчетной. Однако это отличие находится на уровне погрешности измерений. С ростом тока накачки расхождение между экспериментальной и расчетной кривыми несколько увеличивается. По сравнению с расчетами измеренная ширина распределения в ближнем поле уменьшается, а в дальнем поле – возрастает. Такое поведение можно объяснить небольшим динамическим изменением волноводных свойств структуры на фоне ее значительного «встроенного» статического волновода. Поскольку пространственный профиль концентрации носителей вдоль оси у изменяется вследствие их неоднородного «выгорания», то антиволноводное действие носителей зависит от мощности лазера и соответственно тока накачки, т.е. обепечивает волноводный динамический эффект. Более интенсивное ( по сравнению с периферийными областями) «выгорание» носителей происходит в центральной части под гребнем, что приводит к дополнительному волноводному эффекту. Горизонтальное распределение интенсивности волны в ближней зоне сужается, а распределение в дальней зоне соответственно расширяется по мере роста полной мощности излучения. В лазере со «слабым» волноводным эффектом в активной области это приводит к самовоздействию поля на его собственное распределение и к возникновению поперечной неустойчивости поля [5, 10-12] и нелинейности ваттамперной характеристики в виде гистерезисных областей. В нашем случае волноводные свойства структуры достаточно высоки, и влияние носителей на волноводные свойства активной области сводится лишь к некоторому изменению распределений интенсивности в ближней и дальней зонах излучения лазера.

Поскольку относительное изменение распределения интенсивностей в горизонтальном направлении при увеличении мощности лазера невелико, качество оптическо-



Рис.7. Типичная ватт-амперная характеристика оптимизированного лазера и значения параметра качества пучка  $M^2$  при разных токах инжекции. На вставке – спектр излучения лазера при токе 200 мА.

го пучка остается достаточно высоким. В этом можно убедиться, анализируя такой количественный параметр, как фактор  $M^2$ . Для факторизованного представления поперечного распределения интенсивности в лазерном пучке величину этого фактора тоже можно представить в виде

$$M^2 = M_x M_y, \tag{12}$$

где  $M_x$  и  $M_y$  – факторы для вертикальной и горизонтальной плоскостей соответственно. В нашем случае с хорошей степенью точности всегда можно считать, что  $M_x = 1$ ; в горизонтальной плоскости

$$M_{y} = 2k\sigma_{y}\sigma_{\varphi},$$

$$\sigma_{y} = \left[\frac{\int F(y)y^{2}dy}{\int F(y)dy}\right]^{1/2},$$
(13)
$$\sigma_{\varphi} = \left[\frac{\int I(\varphi)\sin^{2}\varphi d(\sin\varphi)}{\int I(\varphi)d(\sin\varphi)}\right]^{1/2},$$

где  $\sigma_y$  и  $\sigma_{\varphi}$  – среднеквадратичные размеры пучка в ближней и дальней зонах соответственно. Для гауссова пучка произведение  $\sigma_y \sigma_{\varphi}$  минимально, при этом  $M_y = 1$ . Отклонение расходимости пучка от дифракционной ведет к росту фактора  $M^2$ . Соотношения (13) были использованы при обработке экспериментальных данных для распределений интенсивности в ближней и дальней зонах.

На рис.7. представлена типичная ватт-амперная характеристика лазера с оптимизированной структурой гребня. В настоящей работе выходная мощность лазера и соответственно ток накачки были ограничены сверху требованиями надежности работы лазера и исключением возможности катастрофического оптического разрушения его выходного зеркала. Начальный участок характеристики соответствует  $M^2 = 1$ , т. е. дифракционному качеству оптического пучка. При выходной мощности свыше 100 мВт происходит некоторый рост фактора  $M^2$ , что обусловлено динамическим изменением распределения интенсивности, но даже при выходной мощности  $\sim 200 \text{ мBT } M^2$ , как правило, не превышает 1.6.

С помощью имеющихся экспериментальных данных можно оценить угловую яркость пучка. В качестве излучающей области примем площадку, ограниченную по уровню 0.1 спада интенсивности от максимального значения. В этом случае, согласно данным рис.5 и 6, излучающая площадка оценивается как 1.3 мкм × 6.3 мкм ≈ 8 мкм<sup>2</sup>, в то время как телесный угол по оценке равен 0.5 ср. Тогда при выходной мощности лазера 200 мВт его усредненная яркость составит 5 × 10<sup>7</sup> Вт·см<sup>-2</sup>ср<sup>-1</sup>. В центре пучка яркость выше, поскольку при оценке в качестве линейных и угловых размеров пучка брались не их ширины на полувысоте, а существенно бо́льшие значения.

Спектр излучения исследованных образцов содержал, как правило, несколько возбужденных продольных мод. Типичный спектр представлен на вставке рис.7 для тока, указанного стрелкой на ватт-амперной характеристике.

#### 5. Заключение

Таким образом, оптимизация волновода гребнёвого лазера позволила получить поперечно-одномодовую генерацию с выходной мощностью свыше 200 мВт, которая ограничивалась только требованием надежности лазера относительно оптического разрушения выходной грани. При этом лазерный пучок обладал близким к дифракционному пределу качеством. Дальнейшее увеличение мощности требует оптического упрочнения выходной грани и является самостоятельной проблемой. Возможно, что для этого необходимо и дальнейшее совершенствование конструкции структуры гребнёвого лазера.

Авторы выражают благодарность И.В.Акимовой за помощь в контроле геометрии резонатора лазера с помощью электронного микроскопа. Работа выполнена в рамках Федеральных целевых научно-технических программ «Квантовые и нелинейные процессы» и «Физика твердотельных наноструктур», программы «Интеграция», проекта «Фундаментальная оптика квантоворазмерных полупроводниковых структур» и проекта INTAS № 2001-571, а также при частичной финансовой поддержке гранта ведущих научных школ (00-15-96624).

- Басов Н.Г., Вул Б.М. Попов Ю.М. ЖЭТФ, 37, 587 (1959); Басов Н.Г., Крохин О.Н., Попов Ю.М. ЖЭТФ, 38, 1879 (1960).
- 2. Laser Focus World, 2, 85 (2001).
- Evans G.A, Butler J.K., Masin V.S. *IEEE J. Quantum Electron.*, 24, № 5, 737 (1988).
- 4. Buus J. IEEE J. Quantum Electron., 18, № 7, 1083 (1982).
- 5. Lang R. IEEE J. Quantum Electron., 15, № 8, 718 (1979).
- Schmidt B., Pawlik S., Mauschek N., Miller J., Pliska T., Troger J., Lichtenstein N., Wittmann A., Moldriek S., Sverdlov B., Harder C. *Techn. Digest Opt. Fiber Comm. Conf. 2002* (2002, paper THGG64, p.702).
- 7. Богатов А.П., Дракин А.Е., Стратонников А.А., Коняев В.П. Квантовая элекроника, **30**, № 5, 401 (2000).
- Stratonnikov A.A., Bogatov A.P., Drakin A.E., Kamenets F.F. J. Opt. A: Pure Appl. Opt., 4, 535 (2002).
- 9. Богатов А.П., Дракин А.Е., Лукьянов С.А., Стратонников А.А., Устинов А.В. *Кр. сообщ. физ.* ФИАН, № 8, 41 (1999).
- Kirkby P.A., Goodwin A.R., Thompson G.H.B., Selway P.R. *IEEE J. Quantum Electron.*, 13, 705 (1977).
- 11. Богатов А.П., Елисеев П.Г., Охотников О.Г., Пак Г.Т. *Квантовая электроника*, **5**, № 11, 2493 (1978).
- 12. Bogatov A. Proc. SPIE Int. Soc. Opt. Eng., 2399, 456 (1995).